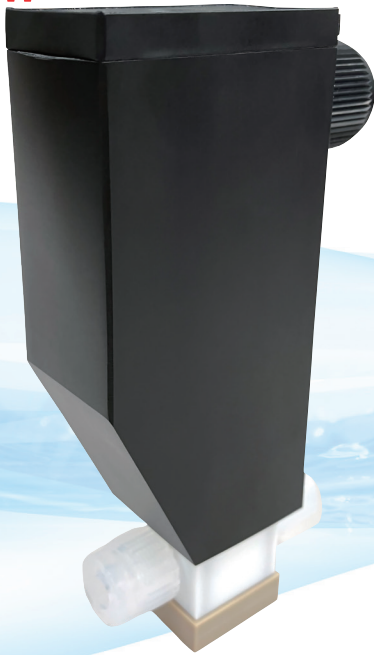


2024/12/11 [WED] ▶ 12/13 [FRI]

東京ビッグサイト ▶ 展示ブース Hall6 6303

NEW



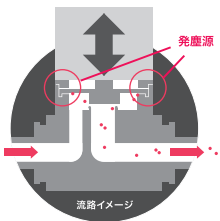
Puras SERIES ダイアフラム式流量制御バルブ
ソレノイドアクチュエータ駆動

MODEL KSFV-100 SERIES

清浄性を追求した特殊溶着構造のバルブ部と
ソレノイドアクチュエータを組み合わせた
新方式の液体用流量制御バルブ

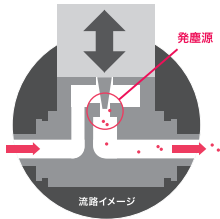
- ✓ 特殊溶着構造により **ダイアフラムの嵌め合い部分が存在せず、コンタミネーション残留無し、リーク無し**
- ✓ ソレノイドアクチュエータとダイアフラム式バルブの組み合わせにより、**数 mL/min からの精密流量制御とシャットオフの二つの役割を兼ね備える**
- ✓ フラッシング時間の低減や微小流量の精密制御で **薬液・洗浄液等の使用量削減**
- ✓ 接流体部は耐薬品性に優れた PTFE
- ✓ 流量範囲 (H₂O) 0 ~ 500mL/min

構造・動作



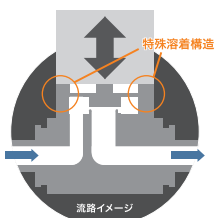
一般的なダイアフラムバルブ

シャットオフバルブとして用いられることが多いダイアフラムバルブは、一般的にダイアフラムを押し下げてシールする構造なので、隙間に滞留したコンタミネーションが出続ける懸念があります。



一般的なニードルバルブ

流量制御バルブとして用いられることが多いニードルバルブは、シャットオフするとニードルがオリフィスに接触して発塵の懸念があるため、シャットオフバルブを別途設けるのが一般的です。

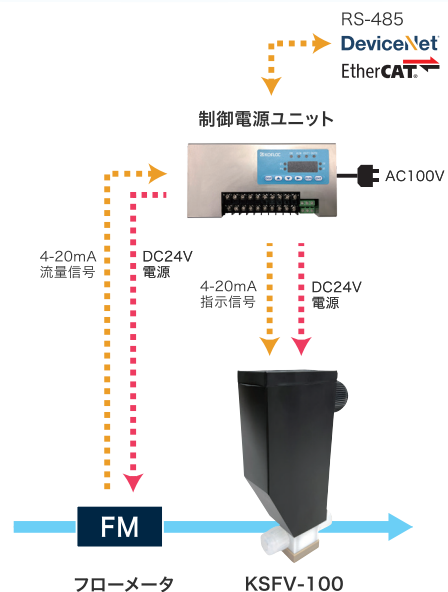


【本製品】 KSFV-100 SERIES

特殊溶着構造によりダイアフラムの嵌め合い部分の無いバルブ部と、ソレノイドアクチュエータを組み合わせることで、コンタミネーション残留が無く、精密流量制御とシャットオフの二つの役割を兼ね備えた新方式のバルブです。半導体製造プロセスで求められる清浄性を有し、微小流量の制御が可能で、しかもシャットオフバルブを別途設ける必要がありません。

(特許：第7146204号)

フローコントロールユニット



KSFV-100 は、フローメータや制御電源ユニットと組み合わせ、液体コントロールユニットとしてご提案が可能です。流量レンジに応じて最適なフローメータを提案します。

NEW



PIマスフローコントローラ

MODEL ST-500 SERIES

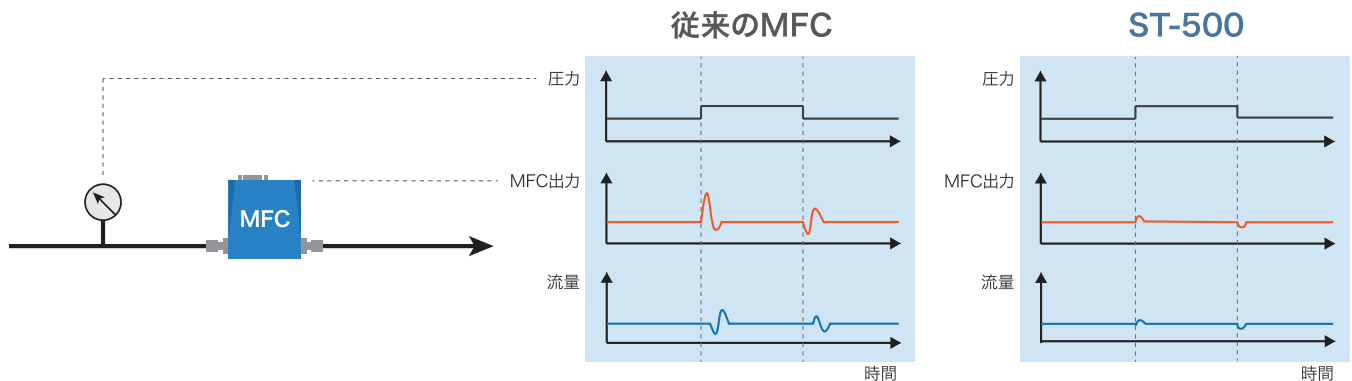
圧力変動に対して安定した流量制御が可能な
半導体製造プロセス用ガスマスフローコントローラ

- ✓ PI…Pressure Insensitive
圧力変動に対し安定した流量制御が可能
- ✓ ダイヤフラム式バルブ採用のメタルシール MFC で、
EP 処理及び酸化被膜処理により腐蝕性流体に対応
- ✓ **DeviceNet 通信対応** (他 EtherCAT[®]、RS485 等)
- ✓ **IGS W シール継手対応**
- ✓ S.P. 精度で高精度な計測が可能、
全流量制御範囲 応答 1sec 以内
- ✓ 専用アプリによるマルチレンジ機能 (30 ~ 110%F.S.)

PI 機能

従来型のマスフローコントローラは、供給側の圧力変動に過敏に反応することで、瞬間的に大きく流量が乱れるなど、制御が不安定になるという課題がありました。ST-500は、この課題を解消するPI機能 (PI…Pressure Insensitive 圧力鈍感性) を新たに備えたマスフローコントローラです。

流量センサ前段に圧力センサを搭載しており、そこで捉えた圧力変動を変動前の圧力と比較しリアルタイムでバルブ開度に補正をかけることで、圧力変動に対して安定した流量制御を行うことが可能です。半導体製造装置など、安定性や正確性が必要となるガス供給プロセスに適しております。



豊富な製品ラインナップと希望仕様に応じた一品一葉のものづくりで
お客様の課題を解決致します。ご来場お待ちしております。

コフロック株式会社

<https://www.kofloc.co.jp/>

京都本社

開発推進本部 マーケティング部

〒610-0311 京都府京田辺市草内当ノ木1-3

tel: 0774-62-4411 (代表) fax: 0774-63-5041

eMail: hpsupport@kofloc.co.jp

